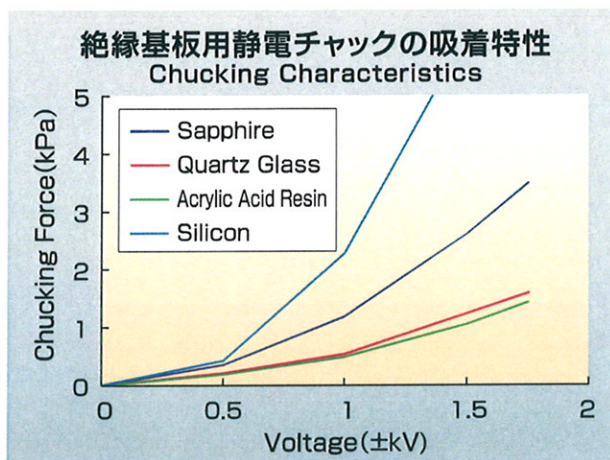
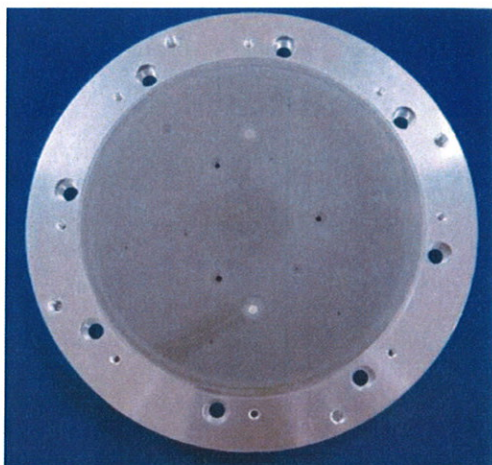


石英静電チャック

Quartz Electrostatic Chucks

サファイア、GaN、SiC、石英、樹脂、シリコン基板用

High Chucking Force for Sapphire, GaN, SiC, Quartz Glass, Resin and Silicon



特長 Features

- 印加電圧±1kVで吸着力1kPa(サファイア)
Chuckling Force : 1kPa at ±1kV(applied to Sapphire)
- 高純度
High Purity
- パーティクルフリー & 低ガス放出
Particle Free and Low Outgas
- 吸脱着1秒以内
Chuckling and De-chucking Response : within 1 sec.
- 最大サイズ $\phi 200\text{mm}$
Size : max. $\phi 200\text{mm}$

用途 Applications

- 化合物半導体用 Compound Semiconductors
LED
パワーデバイス Power Devices
高周波デバイス RF Devices
- MEMS用 MEMS Devices
- 分析・計測用 Test and Measurement Equipment

COVALENT

コバレントマテリアル株式会社
営業部 商品開発グループ
神奈川県秦野市曾屋30 〒257-8566
TEL:0463-84-6613 FAX:0463-81-1984
www.covalent.co.jp E-mail:info.bio@covalent.co.jp